



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2022/2023 навчальний рік, прийому студентів 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_____Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___" _____ 2022 р.

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка Факультет/ІНІ Факультет електроніки
Освітня програма Мікро- та наноелектроніка Форма навчання *Очна*
Освітній ступінь магістра Термін навчання 1 рік 4 місяці
Випускова кафедра *Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ* Кваліфікація Магістр з мікро- та наносистемної техніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практик., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								Контрольні заходи							Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами													
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор		Інд. зан.	СРС	Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР, РР, ГР	ДКР	Реф.	1 курс											
								за НП	з урах. Інд. занять	за НП	з урах. Інд. занять	за НП	з урах. Інд. занять											Всього	у т.ч.	у т.ч.									
			18 тижнів	18 тижнів	у т.ч.	у т.ч.	у т.ч.	у т.ч.	у т.ч.																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																																			
Цикл загальної підготовки																																			
1	Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності	КІВПП	12	0	1.0	30	18	12	-	6	-	-	-	0	12																				
2	Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав	КМ	12	0	2.0	60	36	24	-	12	-	-	-	0	24	2	2																		
3	Основи сталого розвитку	ШІ	12	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24	2	2																		
4	Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації	АМТС1	12	0	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18	2	1							1	2		2								
5	Менеджмент стартап проектів	МП	12	0	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36	1	1								3	1	2								
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					11	330	216	72	0	144	0	0	0	0	114	0	4	4	0	0	0	0	1		5	1	4	0	7	3	4	0			
Цикл професійної підготовки																																			
6	Наноматеріали та нанотехнології	МЕ	12	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	1	1								4	2	2								
7	Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах	МЕ	12	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	1	1								4	2	2								
8	Електронні сенсори	МЕ	12	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	1	1								4	2		2							
9	Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем	МЕ	12	0	7.0	210	108	54	-	54	-	-	-	0	102	1	1								6	3	3								
10	Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Курсовий проект	МЕ	12	0	1.5	45	0	-	-	-	-	-	-	0	45	1																			
11	Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень	МЕ	12	0	2.0	60	27	9	-	18	-	-	-	0	33	1									1.5	0.5	1								
12	Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації	МЕ	12	0	4.5	135	18	-	-	18	-	-	-	0	117	2														1		1			
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					30	900	369	171	0	162	0	36	0	0	531	3	4	4	0	1	2	1	0		19.5	9.5	8	2	1	0	1	0			
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					41	1230	585	243	0	306	0	36	0	0	645	3	8	8	0	1	2	1	1		24.5	10.5	12	2	8	3	5	0			
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																																			
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																																			
13	Моделювання технологій напівпровідникових матеріалів	МЕ	12	0	5.0	150	0	-	-	-	-	-	-	0	150	2	2																		
14	Системи обробки сигналів	МЕ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2	2													3	2	1			
15	Моделювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем	МЕ	12	0	5.0	150	0	-	-	-	-	-	-	0	150	2	2																		
16	Modeling of semiconductor materials, devices and integrated circuits	МЕ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2	2													3	2	1			
17	Системи перетворення сигналів	МЕ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2	2													3	2	1			
18	Конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем	МЕ	12	0	5.0	150	0	-	-	-	-	-	-	0	150	2	2																		
19	Design of semiconductor devices and integrated circuits	МЕ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2	2													3	2	1			
20	Бездротові сенсорні мережі	МЕ	0	0	5.0	150	54	36	-	18	-	-	-	0	96	2	2													3	2	1			
21	Системи обробки цифрової інформації	МЕ	12	0	4.0	120	0	-	-	-	-	-	-	0	120	2	2																		
22	Спецкурс мікро- та наносистемної техніки	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	2	2													3	2	1			

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практи., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами											
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор		СРС	Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	1 семестр			2 семестр								
								за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять										Інд. зан.	18 тижнів			18 тижнів							
									у т.ч.			у т.ч.			у т.ч.			у т.ч.																
						Лекц			Практ			Лаб			Всього			Лекц			Практ			Лаб										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
23	<i>Special course of micro- and nanosystem technology</i>	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1				
24	<i>Фотоніка</i>	МЕ	12	0	4.0	120	0	-	-	-	-	-	-	0	120		2	2					2											
25	<i>Photonics</i>	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1				
26	<i>Оптоелектронні інформаційні системи</i>	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1				
27	<i>Optoelectronic information system</i>	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1				
Разом вибірових ОК циклу професійної підготовки					23	690	270	180	0	72	0	18	0	0	420	3	2	5	0	0	3	1	1	0	0	0	0	15	10	4	1			
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	270	180	0	72	0	18	0	0	420	3	2	5	0	0	3	1	1	0	0	0	0	15	10	4	1			
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					64	1920	855	423	0	378	0	54	0	0	1065	6	10	13	0	1	5	2	2	24.5	10.5	12	2	23	13	9	1			
Кількість					Кількість екзаменів		6		3				3																					
					Кількість заліків		10		4		6																							
					Модульн. (темат.), контр. робіт		13		6		7																							
					Курсових робіт		0																											
					Курсових проектів		1		1		3																							
					РГР, РР, ГР		5		2		3																							
					ДКР		2		1		1																							
Рефератів		2		1		1																												

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 05/22 від 2022-05-31

Завідувач кафедри МЕ

(підпис)

Анатолій ОРЛОВ

Декан факультету (директор інституту)

(підпис)

Валерій ЖУЙКОВ

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;